科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 4月 1日現在

機関番号:14401 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2008~2010 課題番号:20540314 研究課題名(和文) 極限環境原子間力顕微鏡による磁性原子膜の物性研究

研究課題名(英文) Investigation of physical properties of magnetic thin film with atomic force microscopy in extreme field 研究代表者 内藤 賀公(NAITOH YOSHITAKA) 大阪大学・工学研究科・助教 研究者番号:90362665

研究成果の概要(和文):

固体表面に発現する特異な磁性や電荷秩序や弾性状態を原子スケールで明らかにすることを目 的として、原子間力顕微鏡の高感度化を行った。まず、原子スケールで表面弾性情報を取得す る技術を考案し、多周波数周波数変調原子間力顕微鏡法を開発した。この手法により、固体表 面の歪分布や表面原子の結合の硬さ情報を取得できるようになった。また、磁気交換相互作用 を分離測定する方法を考案し、磁性情報を取得可能であることを実証した。

研究成果の概要(英文):

I developed several measuring techniques of noncontact atomic force microscopy for investigating physical properties at the atomic scale such as magnetism, electron charge and elastic distribution on a surface. First, I invented the multifrequency frequency modulation atomic force microscopy (MF-FM-AFM) and performed its observation on semiconductor surfaces at room temperature. The elasticity information of the surfaces was successfully obtained at the atomic scale. Therefore I demonstrated the MF-FM-AFM is expected to be useful for the investigation of the surface elasticity at the atomic scale. In addition, I found and verified the novel method of extracting the magnetic exchange interaction on a surface from the total interaction working between AFM tip and the surface using micro wave.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	1,700,000	510,000	2,210,000
2009 年度	1,100,000	330,000	1,430,000
2010 年度	600,000	180,000	780,000
年度			
年度			
総計	3,400,000	1,020,000	4,420,000

研究分野:表面物理科学 科研費の分科・細目:物性 I・物理学 キーワード:原子間力顕微鏡、表面弾性、磁性、

1.研究開始当初の背景

昨今のエレクトロニクスの技術開発にお いて、ナノ空間領域で電子のスピン、電荷、 軌道の自由度を制御することが必要となっ てきている。殊に固体表面や界面では、対称 性の低下により表面における磁気モーメントが増大し、スピン秩序に特異な性質を持つようになる。また、絶縁体表面に原子や分子が吸着すると、化学的に弱く結合し、電荷が局在しやすく大きな双極子モーメントを発生したりする。したがって、絶縁体表面上に

配列させた磁性原子膜はバルクにはないユ

ニ発期たに状と荷影れっ気待ー現待、よ態磁秩響らて磁さクすさ外りが気序をが変気なるの面化序容け関す果図質と。変弾すや易、をるもりががま化性る電にそも電期)。



マルチフェロイック物性

しかし、こういった絶縁体基板上の興味 深い現象を明らかにするための有力な実験 的研究手段、つまり、原子スケールで電荷、 磁気特性を計測する技術は未開拓であった。 スピン偏極走査トンネル顕微鏡法や非弾性 トンネル分光法は固体表面構造や磁性特性 をサブナノスケールで観測できる有力な手 法であるが、基板や試料が伝導体である必要 がある。

一方、プローブ探針と表面との力学的相互 作用力を検出する非接触原子間力顕微鏡 (NC-AFM)(図2)は、伝導体・絶縁体を問 わずにその表面を観測できる。また、固体表 面の原子構造の画像化だけでなく、表面原子 の微細な変位をとらえることも可能となっ てきている。つまり、NC-AFM がサプ原子ス ケールで固体表面を精確に観測できること を示唆する。また、探針-試料間に働く相互 作用力から静電気力相互作用や交換力相互 作用を抽出することが可能である。最近では、 固体表面の電荷情報を一電子レベルで検出 したり、絶縁体基板の電荷分布や磁性探針を 用いることでスピン情報を画像化したりす ることが可能となってきている。



図2:NC-AFM概略図 2.研究の目的

本研究の当初の目的は、絶縁体基板上に2 次元磁性原子膜を作製し、原子間力顕微鏡を 用いてその構造を明らかにし、さらにそこに 発現する磁性秩序や電荷秩序や弾性秩序の 発現機構を原子スケールで明らかにするこ とであった。また、こういった特異な表面物 性情報を取得するためには現有の原子間力 顕微鏡装置の検出感度を向上させる必要が ある。そのための新しい計測技術や物性情報 取得手法の開発を行うことを目的とした。

3.研究の方法

(1) 絶縁体基板表面の作製

絶縁体基板表面には CaF₂(111)/Si(111)表面、 NaCl(100)/Cu(111) 表面を用いた。これら表 面は、超高真空装置内で基板表面を清浄化し た後に各絶縁膜を作製するための材料を蒸 着して作製した。また、Cu(110)表面を酸化 した 2x1 構造もしくはその高酸化表面であ る c(6x2)構造表面も基板表面として用いた。

(2) 磁性原子蒸着機構の開発

絶縁性基板表面に蒸着する磁性原子として 鉄、マンガンを用いた。絶縁体基板に膜形成 する際に格子定数が変化することによって 磁性をになう d や f バンドのバンド幅も変 るので、多様な磁性が期待できる。また、絶 縁体基板表面において吸着原子は弱い束縛 力を受けるため、室温では拡散しやすく磁性 原子を基板表面上に担持することは難しい と考えられる。また、サーファクタント効果 により、酸化銅表面では基板表面原子と磁性 原子が置換すると考えられる。そこで磁性原 子を基板表面に担持させる対策として、 NC-AFM装置の試料準備室内に基板を低温(液 体窒素温度(77K)~室温)に保持して蒸着 できる機構を開発した。

(3) 先鋭な金属(磁性)探針の実現

使用する市販のカンチレバー探針の母材は シリコン(Si)である。Si探針表面の特異な 電子状態は静電気力分光測定に影響を与え る。また、交換相互作用力の測定には金属磁 性材料で修飾された探針が必要である。さら にこれらの空間分解能をあげるためには原 子レベルで先鋭な探針が要求される。そこで NC-AFM 装置内で鉄原子をカンチレバー探 針に蒸着することで独自に先鋭な探針を作 製した。

(4) 磁性原子膜の作製と原子間力顕微鏡に よる観察

ー原子層から数原子層程度の原子レベルで オーダーした磁性原子膜を作製する。磁性原 子の配列状態をNC-AFM観察により確認し、 蒸着条件(蒸着量、蒸着速度、基板温度等) を最適化する。得られた絶縁体基板上で磁性 原子がどのように配列するかを現有の超高 真空極低温(5K)高磁場下(最大 9T)で動作す る原子間力顕微鏡装置を用いて明らかにす る。さらにこの現有の装置の更なる検出感度 の高感度化を図り、静電気力分光(EFM/EFS) 測定によって電荷分布を観測し、その分布に 秩序があるか、強誘電性が存在するか等を詳 細に調べその発現機構を解明する。また、磁 性探針を用いて磁性原子膜上の交換相互作 用力を高感度にとらえることでその磁性秩 序を探る。

4.研究成果

(1) 表面弾性情報を高感度に取得する技術の開発

従来の FM-AFM では、表面の凹凸変化と相互 作用力の変化を区別することができず、固体 表面の弾性や結合力に関する情報を原子ス ケールで捕らえることは難しい。試料表面弾 性情報を原子スケールで探るためには、原子 間力顕微鏡でとらえる探針 - 試料間相互作 用力の検出感度をさらに向上させなくては ならない。従来の原子間力顕微鏡法では一般 にカンチレバーの1次共振を使って数~十 nm 程の振幅で励振させる。しかし理論的に は検出感度を向上させるには振動振幅を原 子スケール(~0.1nm)まで減らした方がよ い。一方、小振幅にするとカンチレバーの復 元力が弱くなり、探針 - 試料間相互作用力よ リ小さくなりカンチレバーの振動状態が不 安定になるため物性情報の取得が困難にな る。そこで新しく多周波数モードを使った多 周波数周波数変調原子間力顕微鏡法(多周波 数 FM-AFM)という測定技術を新たに開発 した[2]。この技法はカンチレバーを大振幅 の1次共振モードと小振幅の2次共振モード で同時に励振させる。この励振状態のカンチ レバーを試料表面に近づけ、探針試料間相互 作用力をそれぞれの共振周波数からの周波 数シフト量を安定に検出することに成功し た。このとき表面弾性情報は2次モードの周 波数シフト量(Δf2)に反映することが理論的 に考察でき、1次モード(Δf1)を用いた表面の 凹凸像の取得と同時に表面弾性情報を原子 スケールで画像化することが可能となった (図3)。



f₂ 図 3: 多周波数周波数変調原子間力顕微鏡 によるカンチレバー励振

(2)磁気交換相互作用を分離測定する方 法を考案・実証

磁性薄膜の磁気的性質を理解するために最 も重要なことは、原子間の磁気交換相互作用 を高感度に検出することである。最近、研究 代表者は、磁気交換力顕微鏡において、この 磁気交換相互作用だけを測定する方法とし て、強磁性体をコートした探針先端に変調さ れたマイクロ波を照射し、探針の磁化状態を 強磁性共鳴により変調し、探針・試料間相互 作用力の変調成分を抽出するという着想に 至った(図4)。鉄(Fe)コートされた顕微鏡探 針に周波数が約 1.7GHz のマイクロ波を照射 することにより、探針の磁化状態を変調でき ることを実験的に検証することに成功した。



(3) Si(001)ステップから生じる表面歪と構造

変化の観測 NC-AFM を用いて、極低温(5K)下でシリコン (Si(001))のステップ近傍に集中する表面応 力が、非対称ダイマー構造に与える影響につ いて調べた[3]。そこで、ステップを挟んだ2 つのテラス間で初めて異なるダイマー構造 が観測された。つまり、上テラスでは c(4x2) 構造が、下テラスでは p(2x1)構造が観測され た。また、ダイマー構造の平均プロファイル



図5: (a) Si(001)ステップでのAFM凹凸像(春)と散逸 像(赤)のラインプロファイル。(b) ステップを挟んで上 側テラスのダイマー間距離。ステップ傍ではダイマー 間距離が3.6%縮んでいる。

の解析により、上テラスステップ傍のダイマ ーがダイマー方向に圧縮され、3.6%歪んでい ることを世界で初めて示した(図5)。さらに、表 面応力の変化に伴うダイマー構造の変化の様 子を NC-AFM 散逸像からうかがうことができた。 これは NC-AFM による表面応力検出の可能性 を示唆する。

(4) Ge(001)表面における凹凸像と弾性情報 像の同時観測

多周波数 FM-AFM 法を用いて原子スケール の複数の物理情報(凹凸像と表面弾性情報) の同時取得を試みた。試料にはゲルマニウム (Ge(001)) 表面を用いた。表面に欠陥が存在 するような表面を形成した。市販のカンチレ バーを2つの共振周波数1次(fl = 141 kHz) と2次(f2 = 882 kHz)で同時に励振させて Ge(001)試料表面に近づけ、探針試料間相互作 用力を共振周波数からのシフト量を検出し た。このとき2つの振動モードの振動振幅は A1=7.3nm と A2=0.13nm に一定に保った。図 6(a)-(c)は同時に得られた Ge(001)表面の凹 凸像とΔf2 マッピングとΔf1 マッピングであ る。Δf1 マッピングには凹凸変化がほとんど ないことから探針試料間距離制御が機能し ていることが分かる。凹凸像と∆f2 マッピン グでは Ge(001)表面のダイマー構造が観測さ れている。∆f2 マッピングでは凹凸像に比べ ダイマー原子が明るくはっきり観測されて いる。また、ダイマー欠陥近傍で∆f2 値が欠 陥のないところと比べて 0.7Hz 大きくなって いることが分かった。このことは欠陥近傍で の表面原子の結合が硬くなっていることを 示唆している。これは理論的に 10mN/m 程度 の硬さの違いであり、ゲルマニウム表面にお いて欠陥近傍の表面原子結合が硬化するこ とを世界で初めて観測することに成功した。



-87Hz -96Hz -59Hz -59Hz -60H ● : buckling up dimer atom Δ½ (Hz) Δ∱1 (Hz) ● : buckling down dimer atom 図6: MF-FM-AFM による欠陥を含む Ge(001) 表面像。

(a) 凹凸像。(b) 4f2 マッピング。(c) 4f1 マッピング。

本研究では、磁性原子膜に発現する磁性、電 荷秩序を明らかにするために絶縁体表面に 均一な磁性原子膜の作製を試みてきた。原子 スケールでフラットな CaF2や NaCl 基板表面 を作製し、そこに低温蒸着装置等を用いて鉄 原子を蒸着させ、磁性原子膜の作製を試みて きた。しかし、それら基板上では均一な原子 膜がいまだに得られていない。また、超高真 空下で清浄な酸化銅表面の作製に成功し、現 在磁性原子(鉄、マンガン)をその試料表面 に吸着させ、原子スケールの磁性膜を観測中 である。今後この系を用いて磁性膜表面の原 子構造と弾性情報を同時に観測し、さらに交 換相互作用力の検出、静電気力分光測定を行 うことで表面磁性や電子物性情報と表面弾 性との関係を探っていく予定である。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

- "Force Mapping on NaCl(100)/Cu(111) Surface by Atomic Force Microscopy at 78 K", Y. J. Li, K. Tenjin, Y. Kinoshita, Z. Ma, L. Kou, <u>Y. Naitoh</u>, M. Kageshima, and Y. Sugawara, *Ultramicroscopy* 2011 in press. (refereed)
- "Simultaneous observation of surface topography and elasticity at atomic scale by multifrequency frequency modulation atomic force microscopy", <u>Y. Naitoh</u>, Z. Ma, Y. J. Li, M. Kageshima and Y. Sugawara, *J. Vac. Sci. Technol.* B Vol. **28**(6), 1210-1214, 2010. (refereed)
- "Effect of Surface Stress around the S_A Step of Si(001) on the Dimer Structure Induced by Noncontact Atomic Force Microscopy at 5 K", <u>Y. Naitoh</u>, Y. J. Li, H. Nomura, M. Kageshima and Y. Sugawara, *J. Phys. Soc. Jpn.* Vol.**79**, No.1, 013601 (4pages), 2010. (refereed)
- "The influence of Si cantilever tip with/without tungsten coating on NC-AFM imaging of Ge(001) surface", <u>Y. Naitoh</u>, Y. Kinoshita, Y. J. Li, M. Kageshima and Y. Sugawara, *Nanotechnology* Vol. 20, 264011 (7pages), 2009. (refereed)
- "Study of Oxidized Cu(110) Surface Using Noncontact Atomic Force Microscopy", S. Kishimoto, M. Kageshima Y. J. Li, <u>Y. Naitoh</u>, and Y. Sugawara, *Surface Science*, Vol. 602, 2175-2182, 2008. (refereed)
- 6. "Atomic-Scale Imaging of B/Si(111) √3 x √3 Surface by Noncontact Aromic Force Microscopy", M. Kinoshita, <u>Y. Naitoh</u>, Y. J. Li, M. Kageshima and Y. Sugawara, *Jpn. J. Appl. Phys.* Vol. **47** (10), 8218-8220, 2008. (refereed)

[学会発表](計11件)

- 多周波数 FM-AFM による表面形状と弾性の原子レベル同時測定,<u>内藤賀公</u>,馬宗敏,李艶君,菅原康弘,応用物理学会 神奈川 2011 年 3 月 24 日
- 2. Simultaneous measurement of surface topography and elasticity at atomic scale

by multifrequency FM-AFM, <u>Y. Naitoh</u>, Y. Kinoshita, Y.J. Li and Y. Sugawara, 3rd International Symposium on Atomically Controlled Fabrication Technology, Osaka, November 25, 2010

- 多周波数原子間力顕微鏡法の開発と Ge(001)の表面弾性に関する研究 内藤賀 公、馬宗敏、李艶君、菅原康弘 表面科 学会学術講演会 大阪 2010 年 11 月 6 日
- Electrostatic force spectroscopy on semiconductor surfaces using 2nd flexural mode of cantilever oscillation <u>Y. Naitoh</u>, Y. Kinoshita, Y.-J. Li and Y. Sugawara 13th International conference on NC-AFM, Kanazawa, August 3, 2010
- 5. 多周波数原子間力顕微鏡法の開発と表面 弾性に関する研究 内藤賀公, 馬宗敏, 李 艶君, 影島賢已, 菅原康弘 関西薄膜・表 面物理学セミナー, 大阪 2009 年 11 月 27 日
- Theory of Multifrequency Method in FM-AFM Z. Ma, <u>Y. Naitoh</u>, Y. J. Li and Y. Sugawara, 2nd International Symposium on Atomically Controlled Fabrication Technology, Osaka, November 25, 2009
- Bi(001)薄膜表面の原子間力顕微鏡/静電 気力分光測定 神森康樹、<u>内藤賀公</u>、影島 賢巳、菅原康弘 日本物理学会 2009 年秋 季大会 熊本 2009 年 9 月 27 日
- 多周波数原子間力顕微鏡法の開発と Ge(001)の表面弾性に関する研究 内藤賀 公、馬宗敏、影島賢巳、菅原康弘,日本物 理学会 2009 年秋季大会 熊本 2009 年 9月 28 日
- Theory of Multifrequency Method in FM-AFM Z. Ma, <u>Y. Naitoh</u>, Y. J. Li, M. Kageshima and Y. Sugawara, 12th International Conference on Noncontact Atomic Force Microscopy, USA, August 12, 2009
- Atomic scale elasticity mapping of Ge(001) surface by multifrequency FM-AFM <u>Y.</u> <u>Naitoh</u>, Y. Kinoshita, Y. J. Li, M. Kageshima and Y. Sugawara 12th International Conference on Noncontact Atomic Force Microscopy, New Haven, August 14, 2009
- NC-AFM observation of Ge(001) surface by improved cantilever with sharp tungsten tip, <u>Y. Naitoh</u>, Y. Kinoshita, M. Kageshima and Y. Sugawara, 11th International Conference on NC-AFM, Madrid, September 18, 2008

6 . 研究組織

(1)研究代表者
内藤 賀公(NAITOH YOSHITAKA)
大阪大学・工学研究科・助教
研究者番号:90362665